

Résumé de la formation :

Formation à la carte : veuillez contacter le responsable pédagogique pour la planification de la session.

Limité à 12 stagiaires.

Public concerné :

Techniciens supérieurs, chercheurs, ingénieurs

Durée de la formation :

32 heures

45 jours

32 h : 16 h CM + 16 h TP

Lieu : plateforme POPS - Batiment Lippmann

Responsable de la formation :

PEREIRA Antonio

Email : antonio.pereira@univ-lyon1.fr

Objectifs de la formation :

Connaitre les différents procédés d'élaboration de couches minces couramment utilisés dans le milieu académique et industriel.
Acquérir les connaissances pour leur mise en œuvre et pour la compréhension des mécanismes mises en jeu lors de la croissance des couches minces

Programme :

Cours théoriques : 2 jours et demi

Introduction :

- Présentation comparative des différentes techniques de croissance de couches minces
- Mécanismes de croissance et de formation des couches minces
- Technologie du vide : notions de base

Procédés de dépôt physique

- Evaporation thermique
- Ablation laser pulsée (PLD)
- Pulvérisation (continu, RF, magnétron et réactive)
- Procédés assistés par faisceaux d'ions

Procédé physico-chimique

- Dépôt chimique en phase vapeur (CVD)

Procédé chimique

- Elaboration par voie Sol-Gel

Travaux pratiques : 2 jours

- Ablation laser pulsée
- Sol-Gel

- Dépôt chimique en phase vapeur
- Pulvérisation

Conditions de validation :

Attestation de formation.

Lieu principal d'enseignement :

- Villeurbanne - La Doua

Tarifs :

Montant : 1800 euros

Modalités d'inscription :

Bulletin d'inscription à renvoyer complété et signé à inscription.fcsciences@univ-lyon1.fr